

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 7 部門第 2 区分

【発行日】令和 2 年 1 月 23 日 (2020.1.23)

【公開番号】特開 2018-98306 (P2018-98306A)

【公開日】平成 30 年 6 月 21 日 (2018.6.21)

【年通号数】公開・登録公報 2018-023

【出願番号】特願 2016-239776 (P2016-239776)

【国際特許分類】

H 0 1 L 21/027 (2006.01)

B 2 9 C 59/02 (2006.01)

【F I】

H 0 1 L 21/30 5 0 2 D

B 2 9 C 59/02 B

【手続補正書】

【提出日】令和 1 年 12 月 2 日 (2019.12.2)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 0 5

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0 0 0 5】

【特許文献 1】米国特許第 7 3 6 0 8 5 1 号明細書

【特許文献 2】特開 2 0 1 3 - 1 7 5 6 7 1 号公報

【手続補正 2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 4 4

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0 0 4 4】

S 2 0 3 で、制御部 2 6 0 は、取得した配置条件に従ってディスプレイ 2 3 0 を制御して、基板 4 0 上にインプリント材 2 3 1 を配置する。S 2 0 4 で、制御部 2 6 0 は、アライメントスコープ 2 3 2 に、型 3 0 のアライメントマーク 3 1 と基板 4 0 上のインプリント材 2 3 1 との相対位置を計測させる。S 2 0 5 で、制御部 2 6 0 は、この計測により得られる相対位置と S 2 0 2 で取得された相対位置とに基づいて、基板ステージ 2 2 0 を駆動する。例えば、制御部 2 6 0 は、アライメントスコープ 2 3 2 により計測される相対位置と S 2 0 2 で取得された相対位置との距離が許容範囲内に収まるように、基板ステージ 2 2 0 を駆動する。